(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(II)特許出願公表番号 特表2002-525679 (P2002-525679A)

(43)公表日 平成14年8月13日(2002.8.13)

(51) Int.Cl. ³

織別紀号

P I

テーマュード(参考)

G02F 1/19

G02F 1/19

審查前求 未前求 予備審查前求 未請求(全 18 頁)

(21)出願番号 特層2000-571308(P2000-571308) (86) (22)出顧日 平成11年9月8日(1999.9.8) (85)翻訳文提出日 平成12年5月15日(2000.5.15) (86) 国際出願番号 PCT/EP99/06665 (87) 国際公問番号 WO00/17706 (87)國際公開日 平成12年3月30日(2000.3.30) (31)優先権主張番号 98203105.6 平成10年9月17日(1998.9.17) (32)優先日 (33)優先権主張回 欧州特許庁(EP) (81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), JP

(71)出願人 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Koninklijke Philips Electronics N. V. オラング国 5621 ベーアー アインドーフェン フルーネヴァウツウェッハ 1

(72)発明者 ピーター アー ドイン オランダ国 5656 アーアー アインドー フェン プロフ ホルストラーン 6 (72)発明者 ポール ヴァン デル スルイス

752694日 ホール・ファン・ファン・スルイス オランダ図 5656 アーアー アインドー フェン ブロフ ホルストラーン 6 (74)代理人 弁理士 杉村 晩秀 (外2名)

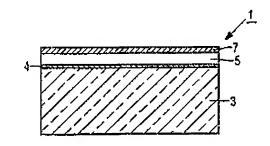
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学スイッテングデバイス

(57)【要約】

遂明基板(3)と、ガドリニウムのような、3値金属の水素化を含んでおり、且つパラジウム層(7)により覆われているスイッチング膜(5)とを具えているスイッチングデバイス(1)が記載されている。前記透明基板(3)とスイッテング膜(5)との間に薄いマグネシウム層(4)が挿入されている。水素の交換により、前配スイッチング膜は透明状態から非常な反射性状態へ可逆的に切り換えられ得る。個状態の間の変換は可逆的であり、且つこの現象は、例えば、照明数層において又は環境削積のために用いられ得る。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、3価金属の水素化物を具えたスイッチング膜とを具えている光学スイッチングデバイスであって、前記水素化物は水素の交換によって、低水素で鏡状の構成と高水素で透明構成との間を可逆的に切り換えられ得る光学スイッチングデバイスにおいて、

薄いマグネシウム層が前記基板と前記スイッチング膜との間に配設されたことを特徴とする光学スイッチングデバイス。

【請求項2】 請求項1記載のデバイスにおいて、前記マグネシウム層の厚さが 0.1と25nmとの間、好適には0.1と10nmとの間であることを特徴と する光学スイッチングデバイス。

【請求項3】 請求項1記載のデバイスにおいて、前記3価金属が、ガドリニウム、エルビウム、サマリウム、ルテチウム、イットリウム及びランタンから成る 群から選択されることを特徴とする光学スイッチングデバイス。

【請求項4】 請求項1記載のデバイスにおいて、前記スイッチング膜が、パラジウム、白金、コバルト及びニッケルから成る群から選択された少なくとも一つの金属を具えている触媒的活性層を設けられていることを特徴とする光学スイッチングデバイス。

【請求項5】 請求項1記載のデバイスにおいて、前記スイッチング膜が20から1000nmまでの範囲内の厚さを有することを特徴とする光学スイッチングデバイス。

【請求項6】 請求項1記載のデバイスにおいて、前記スイッチング膜が3個金属と5~95 at.%のマグネシウムとの合金の水素化物を具えていることを特徴とする光学スイッチングデバイス。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか1項記載のスイッチングデバイスの、表示装置又は可変透過率を有する鏡として、又は照明器具、視覚制御ガラス、建築用ガラス又はサンルーフにおける使用。

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、基板と、3価金属の水素化物を具えたスイッチング膜とを具えている光学スイッチングデバイスに関するものであり、その水素化物は水素の交換によって、低水素で鏡状の構成と高水素で透明構成との間を可逆的に切り換えられ得る。本発明は、そのようなスイッチングデバイスの使用にも附加的に関係している。

[0002]

本出願人により出願された特表平11-514795号公報 (国際特許出願WO 98/1032 9) に、ガドリニウム水素化物GOH、のような、3価金属の水素化物の膜が、水素 の交換により、低水素 (x <≒2>構造と高水素(x >≒2)構造との間を、可 逆的に切り換えられ得る、スイッチングデバイスが開示されている。両構造は異 なる光学特性を有している。低水素含有量 (x < ≒ 2)においては、その膜は金 属の鏡状、すなわち反射性特性を有し、且つ不透明である。高水素含有量 (x > ⇒2)においては、その膜は半導電性で、透明且つ伝達において黄色である。低 水素状態におけるスイッチング膜が水素に露出された場合、鏡状の状態が水素の 豊富な透明状態へ変換される。その透明膜は加熱と水素の緋気との双方又はいず れか一方により、鏡状の状態へ変換し戻されえる。このスイッチング動作は室温 において実効され得る。前記の特許出願は3価金属とマグネシウムとの合金の水 素化物の使用をも開示している。その合金内のマグネシウムの存在が、透明状態 におけるスイッチング膜の透過率を増大し、且つ不透明状態における透過率を減 少させ、そのスイッチング膜の透明状態と不透明状態との透過率の間の比である 、コントラストの改善に帰着する。マグネシウムの附加がそのスイッチング膜を 透明状態において無色にする。その上、鏡状の状態から透明状態へのスイッチン グ速度が増大される。

[0003]

特表2002-525679

90%を越える反射率を有する、アルミニウムのような金属反射器のレベルに匹敵する、レベルまで増大され得ることが望ましい。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

高水素状態における透過率に悪影響することなく、低水素状態における光学ス イッチングデバイスの反射率を増大することが、本発明の目的である。

[0005]

この目的は、薄いマグネシウム層が前記基板と前記スイッチング膜との間に配設されたことを特徴とする、冒頭文節に特定された光学スイッチングデバイスにおいて達成される。驚くべきことに、基板とスイッチング膜との間への薄いマグネシウム層の挿入が、透明状態におけるそのデバイスの透過率を減少させることなく、そのスイッチング膜が反射状態にある場合にそのスイッチングデバイスの反射率を著しく増大することが見出された。例えば低水素状態(約GOH、構成)におけるガドリニウム水素化物膜を有するスイッチングデバイスにおいては、その反射率が約15%から約70%まで増大される。そのガドリニウム水素化物膜が高水素状態(約GOH、構成)にある場合には、そのデバイスの透過率はそのマグネシウム膜により事実上変えられない。

[0006]

薄いマグネシウム層はそのスイッチング膜の厚さの約0、001~0、1倍である厚さを有する層を意味するととられねばならない。優先的実施例では、マグネシウム層の厚さは0.1と25nmとの間である。0.1nm以下ではその効果が著しく小さいのに対して、25nm以上ではその効果はそれ以上改善されない。その上、より大きい厚さのマグネシウム膜は透明状態でのそのスイッチングデバイスの透過度を低減されさせるであろう。

[0007]

Gdは別として、他の3価の遷移金属及び希土類金属、及びこれらの金属の合金が、類似の現象を現す。これらの金属の中で、例えばエルビウム (Er)、サマリ

3 価金属とマグネシウムとの上述の合金の代りに、3 価金属とマグネシウムとの非常に薄い(1~2 nm)交互に並ぶ層の多層積層が、例えば5 0 Mg | Cd対の多層積層が用いられ得る。そのような多層はそれが光学状態間のスイッチング速度の増大へ導くと言う付加的な利点を有している。

[0009]

このスイッチング膜のスイッチングは水素の交換により行われる。このスイッチング膜の透過率は水素含有量により支配され、水素含有量が増加するに従って透過率が増加する。分子水素ガスがこのスイッチング膜へ供給された場合に、透過率が水素圧が増加するに従って増加する。水素は原子Hへ分解されねばならない。その解離の速度はそのスイッチング膜の表面へ、例えば5nmの厚さを有するパラジウムの薄い層を設けることにより増大され得る。前記の厚さにおいて、そのパラジウム層は断続する。その層厚さは決定的ではなく、2と25nmとの間の範囲内にあるように選ばれる。しかしながら、パラジウム層の厚さがそのスイッチングデバイスの最大透過率を決めるので、2~10nmの薄い層が好適である。それに加えて、そのパラジウム層は下にあるスイッチング膜を酸化に対して保護する。

[0 0 1 0]

パラジウムは別として、白金、ニッケル及びコバルト、又はこれらの金属の合金、又はニオブーパラジウム二重層のような、水素解離を増進させる他の触媒的活性金属が、そのスイッチング膜上に設けられ得る。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

分子水素は、水素ガスシリンダーからそのスイッチング膜まで、室温において 簡単な方法で通され得る。低水素、鏡状のスイッチング膜はそれで透明な水素の 豊富な状態へ変化する。この変換は可逆的であり、その透明な膜は、加熱と水素 の排気との双方又はいずれか一方により、鏡状の状態へ変換される。前記の可逆 的変換は室温に近い温度において、又はもっと高い温度において行われ得る。切 原子水素は、次の反応

 $H_2 \bigcirc + e^- \rightarrow H + \bigcirc H^-$

に従ってそのスイッチング膜における水の電解還元によるような、他の方法においても得ることができる。

[0013]

原子水素は水素プラズマから附加的に発生され得る。この場合においては、例 えば、パラジウムの触媒的活性層は必要ない。原子水素は、本質的に知られた水 素蓄積用の金属合金のような、他の金属水素化物からも発生され得る。

[0 0 1 4]

本発明によるスイッチング膜は薄く、すなわちそれの膜厚さは2μmより小さい。このスイッチング膜の膜厚さは好適には100と1000nmとの間にわたる。水素はそのスイッチング膜内に拡散しなくてはならないので、その膜厚さがその鏡状の状態から透明状態への、またその逆の完全変換の速度を決定する。

[0015]

このスイッチングデバイスの層が上に設けられ得る基板は、ガラス、石英、ダイヤモンド、酸化アルミニウムあるいは(柔軟な)合成樹脂の箔のような、透明材料である。この基板は平らでもあるいは曲げられてもよい。

[0016]

その基板はITO又はATOのような透明な導電性の酸化物の薄い層を設けられ得る。そのような酸化物層が国際特許出願WO 98/08139に記載されたような、エレクトロクロミックデバイスにおける透明電極として働く。導電性酸化物層と本発明によるスイッチング膜との間の薄いマグネシウム層の使用が、そのスイッチング膜と導電性酸化物層との間の接着性を改善する付加的な利点を有する。接着の観点からそのマグネシウム層の厚さは好適には0.1と10nmとの間である。

[0017]

[0018]

そのスイッチング膜は、真空蒸着、スパッタリング、レーザ溶発、化学的氣相成長法又は電気めっきのような、慣習的な方法によってマグネシウム層上へ薄い層として貼付される。この点において、このスイッチング層の貼付中及び貼付後に、そのスイッチング膜の金属が酸化を受けないことが重要である。真空蒸着過程においては、これは特に、10⁻⁶~10⁻⁷ mbar以下の低レベルに、残留ガス水又は酸素の圧力を維持することにより達成される。3価金属を10⁻² mbarの圧力で水素と会わせることにより、スイッチング膜内の金属は低水素含有量を有する水素化物状態へ変換され得て、その膜は鏡状の外見を有し、且つ不透明である。更に水素圧を増加することにより、このスイッチング膜は透明になる。

[0019]

例えば、Pdの触媒的活性層、及びマグネシウム層もまた上述の方法のうちの一つによって貼付され得る。

[0020]

本発明によるスイッチングデバイスは反射性の不透明状態から透明状態へ、及びその逆に切り換えられ得るので、そのデバイスは多くの応用に用いられ得る。この光学的効果のおかげで、このスイッチングデバイスは可変ビーム分割器、光学シャッターとして、及び車のヘッドライトのような、照明装置における発光状態又は光ビームの形状を制御するために用いられ得る。そのスイッチング膜の膜厚さに従って、この膜が反射性状態においてほとんど零透過率を現し得る。このことが大きいコントラストを有するスイッチングデバイスが製造されることを可能にする。このスイッチングデバイスは、エレクトロクロミック層が現在用いられている、建築用ガラス、視覚制御ガラス、サンルーフ及びリヤビューミラーのような応用にも用いられ得る。反射性状態においては、可視光のみならず輻射熱すなわち赤外線光も反射されるので、そのようなスイッチングデバイスは環境制御のためにも用いられ得る。そのような窓は太陽エネルギー入力を調節でき、そ

得る。そのような表示装置の構造は、液晶層、配向層、リターデイション層及び 分極フィルタの不存在によって、LCD (液晶表示装置) の構造より非常に簡単 である。

[0022]

[0023]

本発明のこれらの局面が以下に記載される実施例及び添付の図面から明らかになり、且つ本発明のその他の局面が以下に記載される実施例及び添付の図面を参照して解明されるだろう。

[0024]

典型的な実施例 1

図1は、本発明によるスイッチングデバイス1の模型的な、断面図である。層の厚さは比例尺では画かれていない。磨かれた石英基板3が10 nm厚さのマグネシウム層4を設けられている。そのマグネシウム層4上に、スイッチング膜5として働く200 nm厚さのGd(ガドリニウム)膜が貼付されている。それらのマグネシウム層4とスイッチング膜5とは両方とも電子ピーム蒸着によって設けられる。蒸着装置内の残留圧力は10-7mbar(10-7Pa)より低い。堆積速度は1、0 nm/s である。同じ装置内で10 nm厚さのパラジウム層7が0、2 nm/s の堆積速度で抵抗加熱によってスイッチング膜5上へ蒸着される。前記のスイッチング膜5は金属質の外観を有し、且つ不透明である。

[0025]

れる。排気の後に、その圧力セルは5 bar $(5 \times 10^{5}$ Pa)の圧力まで分子水素により室温で満たされる。パラジウム層7がそのスイッチング膜5 内に実質的に吸収される原子Hを形成する。数秒以内にその資料は600 n mにおいて15%の透過率を有する透明になる。かくして形成されたその層は、高水素含有量による600 水素化物60H, (x > = 2、構成はほぼ60H,) を具えている。

[0026]

次に、その圧力セルは10⁻²mbar (1Pa)まで排気される。数秒以内に、透過率は15%から約0.1%まで減少する。この状態において、このスイッチング膜は反射性であり、且つ低水素含有量によるGdの水素化物GdH。(x < ≒ 2、構成はほGGH₂)を具えている。

[0027]

非常に低い透過率を有する反射性スイッチング膜5が、水素に対する更新される暴露により15%の透過率を有する透明膜に変換される。双方の構成の間の変換は可逆的であり、光学スイッチング膜は水素の供給又は排出により得られる。

[0028]

図2はそれらのデバイスが低水素反射性状態にある場合に、400と1000 nmとの間の波長Sにおける、このデバイスと他のデバイスとのアルミニウムに対する%での反射率Rを示している。曲線Aは10nmの厚さを有するマグネシウム層4を有するデバイスの反射率を示している。

[0029]

同じ図において、曲線Bは15 nmの厚さを有するマグネシウム層4を有する 類似のデバイスの反射率Rを示している。曲線Cは20 nmの厚さを有するマグネシウム層4を有する類似のデバイスの反射率を示している。

[0030]

比較のために(本発明によらない)、破線の曲線Dはマグネシウム層4が存在しない類似のデバイスの反射率Rを示している。この図はマグネシウム層4の附

る場合に、400nmと1000nmとの間の波長Sにおいて示されている。曲線A、B、C及びDを現すこれらの装置は図2の装置と対応している。一致する曲線A及びBは、それぞれ10nmと15nmとのマグネシウム層4を有するデバイスの透過率を示している。曲線Cは20nmのマグネシウム層4を有するデバイスの透過率を示している。比較のために(本発明によらない)、破線曲線Dはマグネシウム層4が存在しない類似のデバイスの透過率を示している。この図はマグネシウム層4が存在しない類似のデバイスの透過率に悪影響しないことを示している。しかしながら、図2に示したように、そのデバイスの反射率Rはそのマグネシウム層4により著しく高められる。

[0032]

図3はそれらのデバイスが低水素反射性状態にある場合のそれらのデバイスの透過率Tをも示している。曲線Eは10~20nm厚さのマグネシウム層4を有するデバイスの透過率を示している。破線曲線Fはマグネシウム層4が存在しない場合のそのデバイスの透過率を示している。そのマグネシウム層4の存在がそのデバイスのコントラスト、すなわち高-水素透明状態と低-水素反射性状態とにおける透過性の間の比率の増大を起させる。

[0033]

典型的な実施例 2

実施例1は30at.%Gdと70at.%Mgとを含んでいるスイッチング膜5、及び10nmの厚さを有するマグネシウム層4を反復される。図4における曲線Aは、そのデバイスが高ー水素反射性状態にある場合に、(nmでの)液長5の関数としてアルミニウムに対する%で反射率Rを示している。曲線Aはそのデバイスが、アルミニウム反射鏡に対して、匹敵し、ある波長領域においては凌駕さえすることを示している。比較のために(本発明によらない)、破線曲線Bがそのマグネシウム層4が存在しない類似のデバイスの反射率を示している。そのマグネシウム層4の存在による反射率Rの増強が非常に明らかである。

は、水素の交換により、非常に反射性で、不透明状態から透明状態へ、可逆的に 変換され得る。反射率はアルミニウム反射器の反射率と匹敵して作られ得る。そ のようなスイッチングデバイスは、特に、リヤビューミラー、サンルーフ、建築 用ガラス、視覚制御ガラス、照明装置及び表示装置における、光学スイッチング 素子として用いられ得る。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による光学スイッチングデバイスの模型的な断面図である。

【図2】

ガドリニウムの水素化物のスイッチング膜とそのスイッチング膜が反射性状態にある場合に種々の厚さを有するマグネシウム層とを有するスイッチングデバイスの(nmでの)液長Sの関数として(アルミニウムに対する%での)反射率Rを示している。

【図3】

スイッチング膜が反射状態にある場合、及びスイッチング膜が透明状態にある場合の、ガドリニウムの水素化物のスイッチング膜と、種々の厚さを有するマグネシウム層とを有するスイッチングデバイスの(nmでの)波長Sの関数として(%での) 透過率Tを示している。

[図4]

スイッチング膜が反射性状態にある場合の、Gd。、Mg。、7の水素化物のスイッチング膜と、前記種々の厚さを有するマグネシウム層とを有するスイッチングデバイスの、(nmでの)液長Sの関数としてマグネシウム層有り(曲線A)及び無し(曲線B)の、(アルミニウムに対する%での)反射率Rを示している。

(12)

特表2002-525679

[図1]

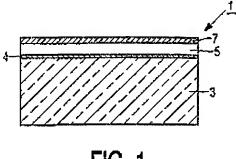


FIG. 1

[図2]

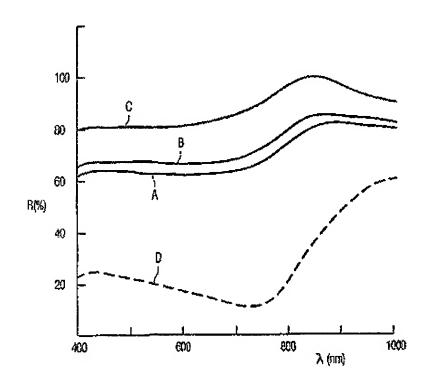
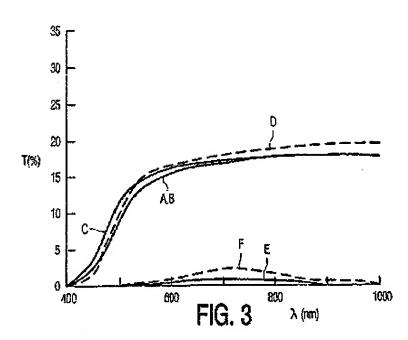


FIG. 2

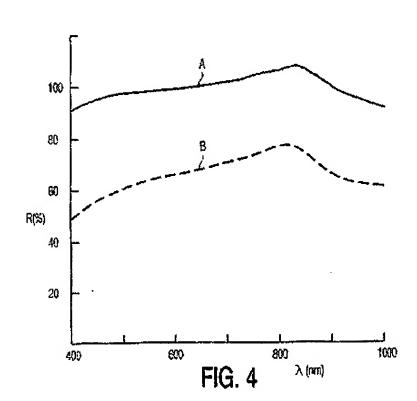
(13)

特表2002-525679





[図4]



特表2002-525679

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH RI	tricer .noi App	na AppNeauon No			
	MIEMAIRMAN SCAROL M	PCT/EP 99/		06665		
A. CLASS	TOATION OF SUBJECT MATTER		·			
TPC 7	G02F1/19			1		
According to	Intermedianal Petront Charatterina (IFC) of the Commissional discontinuous	and #C				
B. FIELDS						
	experted to be supported (Chistain all on system followed by the selfication as	(South		}		
IPC 7	602F			ì		
MATHINISO O	on search ect of notice musical an inimum and initial party search second	gochisheus sta europ	Puded in Ite 112kle se	erched		
	•					
Etectronia de	eta basa consubet during lite i illumazonet soerch (riskne ci esta basa a	na, washe preced	भ्र _{, क्रमाच्या} क्राक्ति ॥३३४)		
	•					
с. пасни	Thaveler 25 of Gereucko Strie					
Calenacy *	Citation of occument, with injuration, where appropriate, of the relocati	ni questagas		Professional and Control (No.		
X	NO 98 10329 A (PHILIPS ELECTRONICS	MA		1,3-\$,7		
	;PHILIPS NORDEN AB (SE))					
	12 Narch 1998 (1998-03-12) cited in the application					
	page 3. Time 11 - Hine 14					
P,X	SLUIS VAN DER P: "OPTICAL SWITCHES	S OF		1,3-7		
	GAGOLINIUM-MAGNESIUM MULTILAYERS"					
,	APPLIED PHYSICS LETTERS, US, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK,	Ą				
	vol. 73', no. 13, page 1826-1828			ļ		
ĺ	KP000784169					
	ISSN: 0003-6951			Į		
1	* the whele document *		1 2			
A	idem		'			
!						
!						
ĺ						
	ther documents are liked with continualization of too C.	Patent fami	it montees are take	i in ancox.		
<u> </u>	SEL SOCIOLISM BY INTO CO.	<u> </u>				
* Sportsu c	meganise of elect documents:	typyr decoment p	unistred after fine titl end politi octobet mig	evantional filing data		
'A' ROSUF	Jed's Cute Bylad are					
uthleading to a vertice of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the representation of the transfer of the representation of the				chimed invention		
Tilling date consect be considered to which the consect be consected to which the consect				Senticity to sekalargous Storagous to sekalargous		
yeloof	elsiment diviention medition standarding					
10. 30 oru	po or other special meenin (as දෙසරෝටයි) ඉස් හේලාරාගුර්ග නිර රැක් ප්රභාලනයට ප්රභු, හෝටනයට ග ආහෝර			euro outro outre decu- botiste moeseg e co eur		
חשטנט "ים"						
hose) share the beauty circle citizened						
Date of the	dates programmed to acitylance penns	रूक्ट स कर।हा	At All a Kirrit Gillanda at			
	December 1999	16/12	/1999			
		Setticized officer				
ANGELIA VICIO	maring address of the ISA European Paters Office, P.B. 5616 Felentious 8	SALIMINA OIN				
ł	(N) = 2200 INV FIGSWER Tel. 4491=201-348-2010, Tel. 31 651 600 FIL	R				
1	Fat: (+21-70) 240-3016	Gill,	13			

(15)

特表2002-525679

•		TIONAL SEARCE		PROEIT. TOPM	Application No. 99/06665	
Paters cocument cited in search report		Fublication date	Pa	elera (amaly Lember(s)	Putlication date	
		12-03-1998	EP 0871926 A US 5905590 A		21-10-1998 18-05-1999	

(15)

特表2002-525679

フロントページの続き

(71)出願人 Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven. Th e Netherlands

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] In the optical switching device to which it is an optical switching device equipped with a substrate and the switching film equipped with the hydride of trivalent metal, and said hydride may be reversibly switched by exchange of hydrogen in between transparence configurations from mirror-like a configuration and high hydrogen by low hydrogen Optical switching device characterized by arranging a thin magnesium layer between said substrates and said switching film.

[Claim 2] It is the optical switching device with which thickness of said magnesium layer is characterized by being for 0.1 and 10nm suitably for 0.1 and 25nm in a device according to claim 1.

[Claim 3] The optical switching device characterized by choosing said trivalent metal from the group which consists of a gadolinium, an erbium, samarium, a lutetium, an yttrium, and a lanthanum in a device according to claim 1.

[Claim 4] The optical switching device characterized by preparing the catalystbarrier layer which said switching film equips with at least one metal chosen from the group which consists of palladium, platinum, cobalt, and nickel in a device according to claim 1.

[Claim 5] The optical switching device characterized by said switching film having the thickness of within the limits to 20 to 1000nm in a device according to claim 1.

[Claim 6] The optical switching device characterized by equipping said switching film with the hydride of the alloy of trivalent metal and the magnesium of 5 - 95 at.% in a device according to claim 1.

[Claim 7] Use [in / as a mirror which has the display or adjustable permeability of a switching device given in any 1 term of claim 1-6 / lighting fitting, vision control glass, structural glass, or a sunroof].

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

The hydride may be reversibly switched by exchange of hydrogen in between transparence configurations from mirror-like a configuration and high hydrogen by low hydrogen about the optical switching device with which this invention is equipped with a substrate and the switching film equipped with the hydride of trivalent metal. This invention is related also to use of such a switching device in addition.

[0002]

To the Patent Publication Heisei 11-No. 514795 official report (international

patent application WO 98/10329) for which these people applied, film of the hydride of trivalent metal like the gadolinium hydride GdHx is low hydrogen (the switching device which may be switched reversibly is indicated in between x <**2> structure and high hydrogen (x>**2) structures.) by exchange of hydrogen. Both structures have a different optical property. In a low hydrogen content (x<**2), the film has and, metaled the shape of a mirror, i.e., reflexibility property, is opaque. In a high hydrogen content (x>**2), the film is half-conductivity and is vellow in transparence and transfer. A mirror-like condition is changed into the abundant transparence conditions of hydrogen when the switching film in a low hydrogen condition is exposed to hydrogen. The transparent membrane can be returned to a mirror-like condition by the both sides or either of heating and exhaust air of hydrogen. Efficiency of this switching operation may be carried out in a room temperature. The aforementioned patent application is also indicating use of the hydride of the alloy of trivalent metal and magnesium. Existence of the magnesium in the alloy increases the transmission of the switching film in a transparence condition, and decreases the transmission in an opaque condition, and results in the improvement of contrast which is a ratio between the transmission of the transparence condition of the switching film, and an opaque condition. Addition of magnesium makes the switching film colorlessness in a transparence condition. Moreover, the switching rate from a condition to a mirrorlike transparence condition increases.

[0003]

The reflection factor of the GdHx switching film in a mirror-like condition (low hydrogen) is about 15 - 20% in a visible wavelength field. (Gd0.3Mg0.7) The reflection factor of Hx switching film is about 50 - 70% in the same condition. It is desirable that it may increase to the same application to the level in which a reflection factor rivals the level of a metallic reflection machine like aluminum which has a reflection factor exceeding 90% suitably.

[0004]

It is the purpose of this invention to increase the reflection factor of the optical

switching device in a low hydrogen condition, without carrying out a bad influence to the transmission in a high hydrogen condition.

[0005]

This purpose is attained in the optical switching device which is characterized by arranging a thin magnesium layer between said substrates and said switching film and which was specified as the beginning clause. Without insertion of the thin magnesium layer of a between [a substrate and switching film] decreasing the transmission of the device in a transparence condition to a surprising thing, when the switching film was in a reflective condition, increasing the reflection factor of the switching device remarkably was found out. For example, in the switching device which has the gadolinium hydride film in a low hydrogen condition (about GdH2 configuration), the reflection factor increases from about 15% to about 70%. When the gadolinium hydride film is in a high hydrogen condition (about GdH3 configuration), the permeability of the device is not changed as a matter of fact with the magnesium film.

A thin magnesium layer's semantics of the layer which has the thickness which is about 0.001 to 0.1 times the thickness of the switching film must take it. In the preferential example, the thickness of a magnesium layer is for 0.1 and 25nm. By 25nm or more, the effectiveness does not improve any more to a thing with it. [the remarkable effectiveness and] [small in 0.1nm or less] The magnesium film of moreover more large thickness has the transmittance of the switching device in a transparence condition reduced, and will be carried out. [0007]

As Gd being another, the alloy of other trivalent transition metals, rare earth metals, and these metals expresses a similar phenomenon. In these metals, they are an erbium (Er), samarium (Sm), a lutetium (Lu), an yttrium (Y), and a lanthanum (La).

[8000]

Instead of the above-mentioned alloy of trivalent metal and magnesium, the

multilayer laminating of 50 Mg|Gd [for example,] pairs [laminating / of the layer located in a line by turns / very thin (1-2nm) / of trivalent metal and magnesium / multilayer] may be used. It has the additional advantage referred to as that it leads such a multilayer to increase of the switching rate between optical conditions.

[0009]

Switching of this switching film is performed by exchange of hydrogen. The permeability of this switching film is governed by the hydrogen content, and permeability increases it as a hydrogen content increases. When molecule hydrogen gas is supplied to this switching film, permeability increases as hydrogen pressure increases. Hydrogen must be decomposed to Atom H. The rate of the dissociation may increase by preparing the film of palladium which has the thickness of 5nm in the front face of the switching film. In the aforementioned thickness, the palladium layer is intermittent. The layer thickness is not decisive, and as it is within the limits of between 2 and 25nm, it is chosen. However, since the thickness of a palladium layer determines the maximum permeability of the switching device, a 2-10nm film is suitable. In addition to it, the palladium layer protects the switching film which is downward to oxidation.

[0010]

Other catalyst-active metals which promote hydrogen dissociation like platinum, nickel and cobalt, the alloy of these metals, or a niobium-palladium double layer except for palladium may be prepared on the switching film.

[0011]

In a room temperature, it may let molecule hydrogen pass from a hydrogen gas cylinder by the easy approach even to the switching film. The switching film of the shape of low hydrogen and a mirror changes to the abundant conditions of transparent hydrogen by it. This conversion is reversible and that transparent film is changed into a mirror-like condition by the both sides or either of heating and exhaust air of hydrogen. The aforementioned reversible conversion may be performed in higher temperature in the temperature near a room temperature. A

switch may be performed also by setting in a hydrogen ambient atmosphere, and heating or cooling the switching film.

[0012]

Atomic hydrogen is the next reaction. According to H2 O+e-->H+OH-, it can obtain also in other approaches so that according to the electrolytic reduction of the water in the switching film.

[0013]

Atomic hydrogen may be generated in addition from the hydrogen plasma. In this case, for example, the catalyst-barrier layer of palladium is unnecessary. Atomic hydrogen may be generated from other metal hydrides like the essentially known metal alloy for hydrogen are recording.

[0014]

The switching film by this invention is thin, namely, the film thickness of that is smaller than 2 micrometers. It goes over the film thickness of this switching film between 100 and 1000nm suitably. Since hydrogen must be diffused in the switching film, the film thickness determines the rate of the transparence condition of the shape of the mirror, and its reverse full conversion from a condition.

[0015]

The substrate with which the layer of this switching device may be prepared upwards is a transparent material like the foil of glass, a quartz, a diamond, an aluminum oxide, or (it is flexible) synthetic resin. This substrate may be bent even if even.

[0016]

The substrate can prepare the film of a transparent conductive oxide like ITO or ATO. It works as a transparent electrode in an electrochromic device with which such an oxide layer was indicated by international patent application WO 98/08139. Use of the thin magnesium layer between a conductive oxide layer and the switching film by this invention has the additional advantage which improves the adhesive property between the switching film and conductive oxide

layer. The thickness of the viewpoint of adhesion to the magnesium layer is for 0.1 and 10nm suitably.

[0017]

The suitable example of the device by this invention is characterized by having the hydride of the alloy of trivalent metal and the magnesium of 5 - 95 at.% for the reason the switching film was mentioned above.

[0018]

The switching film is stuck as a film on a magnesium layer by customary approach like vacuum deposition, sputtering, laser from **, a chemical **** grown method, or electroplating. In this point, it is important that the metal of that switching film does not receive oxidation during pasting of this switching layer and after pasting. In a vacuum deposition process, especially this is attained by maintaining the pressure of residual-gas water or oxygen to the low of 10-6 to ten to seven or less mbars. By making trivalent metal meet hydrogen by the pressure of 10-2mbar, the metal in the switching film may be changed into the hydride condition of having a low hydrogen content, and the film has mirror-like appearance and is opaque. Furthermore, by increasing hydrogen pressure, this switching film becomes transparence.

[0019]

For example, the catalyst-barrier layer and magnesium layer of Pd may also be stuck by one of above-mentioned approaches.

[0020]

Since the switching device by this invention may be switched to a transparence condition and its reverse from a reflexible opaque condition, the device may be used for many application. By the favor of this optical effectiveness, this switching device may be used in order to control a luminescence condition in a lighting system like the headlight of the vehicle as an adjustable beam splitter and an optical shutter, or the configuration of a light beam. According to the film thickness of that switching film, this film can almost express zero permeability in a reflexibility condition. It makes it possible to manufacture the switching device

with which this has large contrast. This switching device may be used also for application like the structural glass and vision control glass with which the electrochromic layer is used now, a sunroof, and a rear view mirror. In a reflexibility condition, since it is reflected, not only the light but radiant heat, i.e., infrared light, such a switching device may be used also for environmental control. Such an aperture can adjust a solar energy input and, thereby, reduces the energy expenditure by the air conditioner.

[0021]

A thin display may be manufactured by making a pattern in the switching film. The structure of such an indicating equipment is very easier than the structure of LCD (liquid crystal display) by un-existing [of a liquid crystal layer, an orientation layer, a retardation layer, and a polarization filter].

[0022]

Also when zero transmission cannot approve in a reflexibility condition because of the reason of insurance, the pattern in this switching film may be used. For example, by patternizing this switching film in photolithography, the delicate pattern which leaves the fixed part of the substrate which is not covered with that switching film can be obtained. In this way, accidental hydrogen leakage of this equipment will not lead to the zero permeability of this device.

It will be solved with reference to the example with which these aspects of affairs of this invention become clear from the example indicated below and an attached drawing, and the aspect of affairs of others of this invention is indicated to be below, and an attached drawing.

[0024]

Typical example 1 Drawing 1 is the sectional view like a model of the switching device 1 by this invention. The thickness of a layer is not drawn by the scale. The magnesium layer 4 of 10nm thickness is formed in the polished quartz substrate 3. On the magnesium layer 4, Gd (gadolinium) film of 200nm thickness which works as switching film 5 is stuck. Both those magnesium layers 4 and switching

film 5 are prepared by electron beam evaporation. The residual pressure in vacuum evaporationo equipment is lower than 10-7mbar (ten to 5 Pa). The rate of sedimentation is 1.0 nm/s. The palladium layer 7 of 10nm thickness is vapor-deposited by resistance heating on the switching film 5 by the rate of sedimentation of 0.2 nm/s within the same equipment. The aforementioned switching film 5 has the appearance of the quality of a metal and is opaque. [0025]

The opaque sample device 1 is arranged in the pressure cell which was able to prepare two apertures of quartz glass. The aforementioned pressure cell is equipped also with the connection section for connecting it for supply of hydrogen to a vacuum pump. The aforementioned pressure cell is arranged in the data interior of a room of a spectrophotometer. After exhaust air, the pressure cell is filled with a room temperature by molecule hydrogen to the pressure of 5bars (5x105 Pa). The palladium layer 7 forms the atom H absorbed substantially in the switching film 5. The data becomes the transparence which has 15% of permeability in 600nm within several seconds. The layer formed in this way is equipped with the hydride GdHx of Gd by the high hydrogen content (2 x>** a configuration about GdH3).

[0026]

Next, the pressure cell is exhausted to 10-2mbar (1Pa). Within several seconds, permeability decreases from 15% to about 0.1%. In this condition, this switching film is reflexibility and is equipped with the hydride GdHx of Gd by the low hydrogen content (2 x<** a configuration about GdH2).

The reflexibility switching film 5 which has very low transmission is changed into the transparent membrane which has 15% of transmission by exposure to hydrogen updated. The conversion between both configurations is reversible and the optical switching film is obtained by supply or discharge of hydrogen. [0028]

drawing 2 -- those devices -- low hydrogen reflection -- description -- when it is in

voice, the reflection factor R in % to the aluminum of this device and other devices in the wavelength S between 400 and 1000nm is shown. Curve A shows the reflection factor of the device which has the magnesium layer 4 which has the thickness of 10nm.

[0029]

In the same Fig., Curve B shows the reflection factor R of the similar device which has the magnesium layer 4 which has the thickness of 15nm. Curve C shows the reflection factor of the similar device which has the magnesium layer 4 which has the thickness of 20nm.

[0030]

The curve D of (it is not based on this invention) and a broken line shows the reflection factor R of the similar device with which the magnesium layer 4 does not exist for the comparison. This drawing shows that addition of the magnesium layer 4 increases a reflection factor R from about 60% to [from about 15%] 80%. [0031]

In drawing 3, when an above-mentioned device has transmission (at %) T in a high hydrogen transparence condition, the wavelength S between 400nm and 1000nm is shown. These equipments showing Curves A, B, C, and D correspond with the equipment of drawing 2. The curves A and B in agreement show the permeability of the device which has the magnesium layer (10nm and 15nm) 4, respectively. Curve C shows the permeability of the device which has the 20nm magnesium layer 4. (It not being based on this invention) and the broken-line curve D show the permeability of the similar device with which the magnesium layer 4 does not exist for the comparison. It is shown that addition of the magnesium layer 4 does not carry out the bad influence of this drawing to the permeability of that device. However, as shown in drawing 2, the reflection factor R of the device is remarkably raised by the magnesium layer 4.

[0032]

Drawing 3 shows the permeability T of those devices in case those devices are in a low hydrogen reflexibility condition. Curve E shows the permeability of the

device which has the magnesium layer 4 of 10-20nm thickness. The broken-line curve F shows the permeability of the device in case the magnesium layer 4 does not exist. Existence of the magnesium layer 4 makes increase of the ratio between the permeability in the contrast of the device, i.e., a quantity-hydrogen transparence condition, and a low-hydrogen reflexibility condition cause. [0033]

Typical example 2 An example 1 has the switching film 5 containing 30at.%Gd and 70at(s).%Mg, and the magnesium layer 4 which has the thickness of 10nm repeated. The curve A in drawing 4 shows the reflection factor R by % to aluminum as a function of wavelength (with nm) S, when the device is in a quantity-hydrogen reflexibility condition. To the aluminum reflecting mirror, the device matches and, as for Curve A, shows that even excellence is carried out in a certain wavelength field. (It not being based on this invention) and the brokenline curve B show the reflection factor of the similar device with which the magnesium layer 4 does not exist for the comparison. Enhancement of the reflection factor R by existence of the magnesium layer 4 is very clear. [0034]

By exchange of hydrogen, the optical switching device equipped with the thin magnesium layer between the switching film of the hydride of trivalent metal, and a substrate and its switching film concerning this invention is very reflexibility, and may be reversibly changed into a transparence condition from an opaque condition. A reflection factor is equal to the reflection factor of an aluminum reflector, and may be made. Such a switching device especially may be used as an optical switching element in a rear view mirror, a sunroof, structural glass, vision control glass, a lighting system, and an indicating equipment.

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1]

It is the sectional view like a model of the optical switching device by this invention.

[Drawing 2]

When the switching film and its switching film of a hydride of a gadolinium are in a reflexibility condition, the reflection factor R is shown as a function of the wavelength (with nm) S of the switching device which has the magnesium layer which has various thickness (with % to aluminum).

[Drawing 3]

When the switching film is in a reflective condition, permeability T is shown as a function of the wavelength (with nm) S of the switching device which has the switching film of the hydride of a gadolinium in case the switching film is in a transparence condition, and the magnesium layer which has various thickness (at %).

[Drawing 4]

Those with a magnesium layer (curve A) and the reflection factor [being nothing (curve B)] (with % to aluminum) R are shown as a function of wavelength (with nm) S of the switching device which has the switching film of the hydride of Gd0.3Mg0.7 in case the switching film is in a reflexibility condition, and the magnesium layer which has said various thickness.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

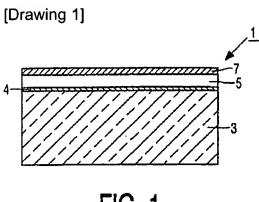


FIG. 1

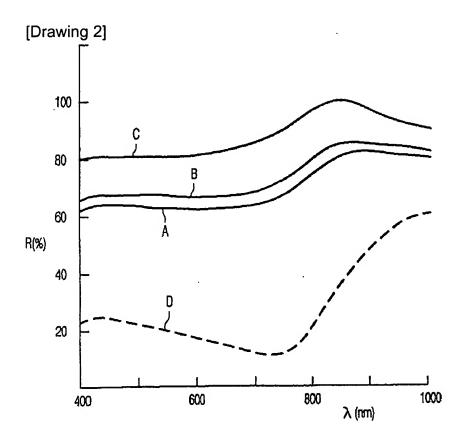
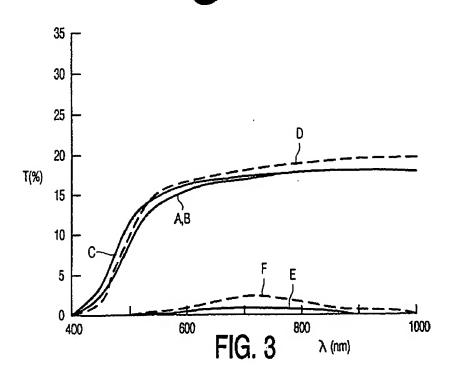
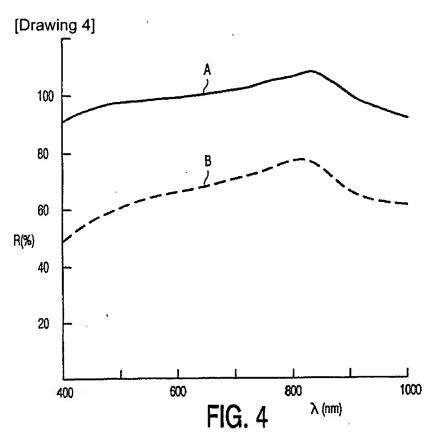


FIG. 2

[Drawing 3]





[Translation done.]

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.